

晶圓瑕疵檢測專家

WaferEye 810



高效、精確的檢測設備，利用先進光學與圖像處理技術迅速檢測晶圓缺陷，提高生產效率，降低廢品率，為生產品質保駕護航，提升市場競爭力。

應用
廣泛

瑕疵
檢測

瑕疵
分析

離線
檢測

影像
高清

觸控
螢幕

智能
軟體

WaferEye 810

廣泛應用範圍

適用於晶圓切割前後的表面瑕疵檢測，滿足多樣化的生產需求。

多元瑕疵檢測

針對晶圓表面碎裂、刮傷、異物、污點、凹陷等瑕疵進行精準檢測。

智能軟體支援

提供直覺式軟體界面，使操作與維護更加便捷高效。

內建電腦與觸控螢幕

設備內置高性能電腦及觸控螢幕，便捷操作與即時影像檢視。

高清影像取像

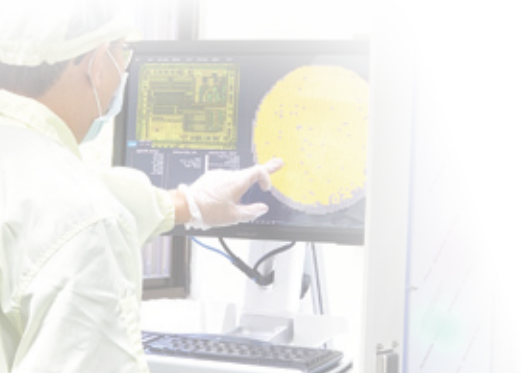
採用高解析度影像捕捉，確保晶圓表面瑕疵檢測的清晰度。

PAD瑕疵分析

專業檢測 PAD 的刮傷與異色情況，提升產品品質。

離線檢測適用

適用於離線檢測模式，靈活適應生產線需求。



產品規格

檢測樣品	光學規格	設備規格
樣品樣式 晶圓玻璃基板	檢測方式 Line Scan	進料方式 手動
尺寸範圍 4"~8"	相機畫素 2K	出料方式 手動
精度要求 10x10µm	檢測精度 2.8µm	Tact Time 500 sec / sheet (8")
檢測專案 PAD : 變色、汙染、變形 Wafer : 刮傷、崩缺、裂痕	設備尺寸 170x130x220cm	操作模式 半自動 控制模式 PC

* 更多有關產品的資訊，請連絡全友電腦當地銷售人員或經銷商。

全友電腦股份有限公司

106 台北市大安區敦化南路二段 76 號 9 樓

電話: +886-2-27035566 傳真: +886-2-27033232

官方網站: www.microtek.com

MICROTEK
SCAN THE WORLD